

佐世保工業高等専門学校	開講年度	平成31年度(2019年度)	授業科目	書道
科目基礎情報				
科目番号	0029	科目区分	一般 / 必修	
授業形態	講義	単位の種別と単位数	履修単位: 1	
開設学科	電気電子工学科	対象学年	2	
開設期	後期	週時間数	後期:2	
教科書/教材	書道 I (東京書籍)			
担当教員	古川 清隆			
到達目標				
1.	「漢字の書」の「楷書」では、幅広い時代や書風の古典を比較しつつ、それぞれの特徴を表現できる。			
2.	「漢字の書」の「行書」では、「蘭亭序」を通して行書の特徴が理解できる。			
3.	「漢字の書」の「隸書」では、「曹全碑」を通して隸書の特徴が理解出来る。			
4.	「漢字仮名交じりの書」では、「生活の中の書」を通して日常生活に応用できるようにする。			
ループリック				
	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	未到達レベルの目安	
評価項目1(到達目標1)	楷書のそれぞれの古典の特徴を理解し表現できる。	楷書のそれぞれの古典の特徴を理解し、ほぼ表現できる。	楷書のそれぞれの古典の特徴を理解できない	
評価項目2(到達目標2, 3)	蘭亭序の表現を通して行書の特徴を理解し表現できる。曹全碑の表現を通して、隸書の特徴を理解し表現できる。	蘭亭序の表現を通して行書の特徴を理解し、ほぼ表現できる。曹全碑の表現を通して隸書の特徴を理解し、ほぼ表現できる。	蘭亭序の表現を通して行書の特徴が理解できない。曹全碑の表現を通して、隸書の特徴を理解できない。	
評価項目3(到達目標4)	生活の中の書を通して日常生活で使用する表現が出来る。	生活の中の書を通して日常生活の中で使用する表現がほぼできる。	生活の中の書を通して日常生活で使用する表現が出来ない。	
学科の到達目標項目との関係				
教育方法等				
概要	書の表現の多様性を創造する充実感を体得する。			
授業の進め方・方法	予備知識: 小・中学校での技術的な基礎とあわせ表現活動の多様性の実感と創造力の育成。 講義室: 視聴覚室 授業形式: 指定した座席により学習、各自がそれぞれ準備し各時間の学習テーマにそって学習 学生が用意するもの: 教科書、用具・用材			
注意点	評価方法: 提出作品が80%、平常点(授業中の取り組む熱意、マナーなど)が20%で評価し、60点以上で合格とする。 技術的なことよりいかに目標に意欲的に取り組むかをより重点的に評価する。 自己学習の指針: テキストを中心に毎回授業の予習・復習に取り組むのに加えて、普段より「書道作品」を鑑賞する機会を見つけてください。			
授業計画				
	週	授業内容	週ごとの到達目標	
後期	3rdQ	1週 中学校までの書写の学習の確認 用具、用材、姿勢、執筆について	中学校までの書写で学習した文字を正しく整えて書く事ができる。 用具、用材、姿勢、執筆について理解できる。	
		2週 書写から書道へ 漢字仮名交じりの書を書く。 いろいろな線による表現を試みる。	漢字と仮名を調和させて書くことができる。 漢字と仮名を調和させて書くことができる。	
		3週 楷書の用筆法、結構法について 唐時代の楷書について	楷書の用筆法、結構法を理解する。 唐時代の楷書の特徴が理解できる。	
		4週 「九成宮醴泉銘」を臨書する 「風景」を書く 清書	「九成宮醴泉銘」の書の特徴を捉えて臨書する。	
		5週 「孔子廟堂碑」を臨書する 「天河」を書く 清書	「孔子廟堂碑」の書の特徴を捉えて臨書する。	
		6週 北魏時代の楷書について 「牛けつ造像記」を臨書する 二字書 清書	北魏時代の楷書の特徴が理解できる。 「牛けつ造像記」の書の特徴を捉えて臨書する。	
		7週 「鄭義下碑」を臨書する 二字書 清書	「鄭義下碑」の書の特徴を捉えて臨書する。	
		8週 行書の特徴について	行書の特徴が理解できる。	
	4thQ	9週 「蘭亭序」(王羲之)について 「天朗」を書く 清書	「蘭亭序」の臨書、鑑賞を通して特徴を把握する。	
		10週 四字書を書く 清書	二字熟語を「蘭亭序」の特徴を生かして表現する。	
		11週 隸書の成立と特徴について 清書	隸書の成立と特徴が理解できる。	
		12週 「曹全碑」を臨書する 「世紀」	「曹全碑」の書の特徴を捉えて臨書する。	
		13週 二字書を書く 清書	二字熟語を「曹全碑」の特徴を生かして表現する。	
		14週 小筆による実用書 清書	小筆による実用書の書き方を体得する。	
		15週 硬筆による実用書	硬筆による実用書の書き方を体得する。	
		16週		
評価割合				
	提出作品	平常点(授業中の取り組む熱意、マナーなど)	合計	
総合評価割合	80	20	100	
基礎的能力	80	0	80	
分野横断的能力	0	20	20	